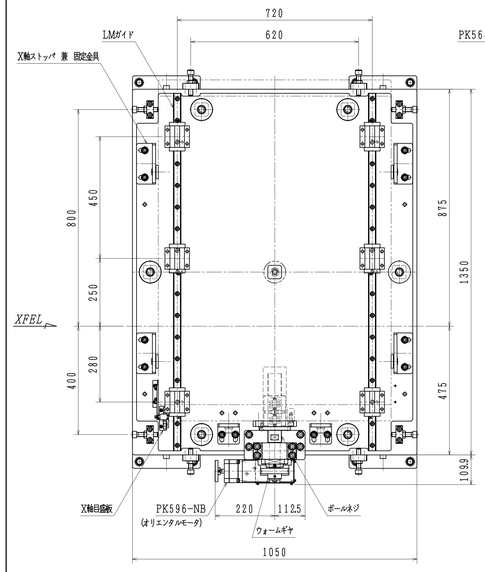
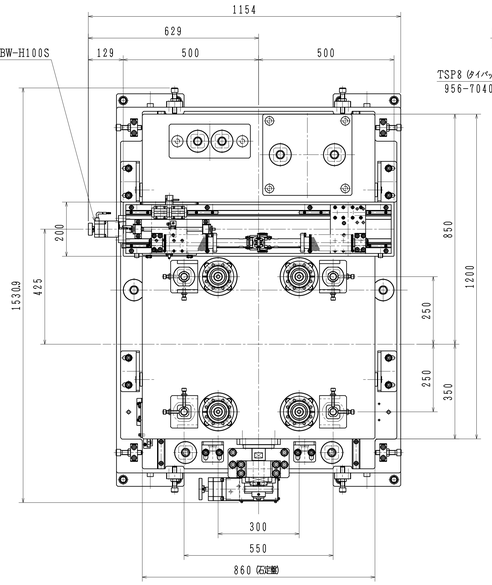
表面粗さ JIS・ISO　指示マイナ表面粗さは、表面パイル。

Ra ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

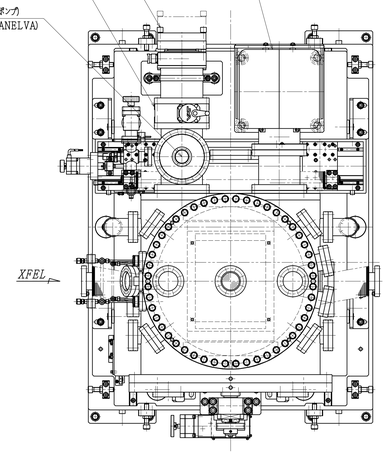
<検図> 形 寸 枠 表 組

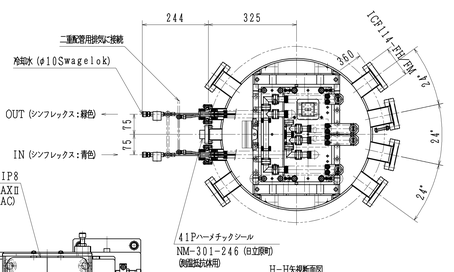


B－B矢視断面図

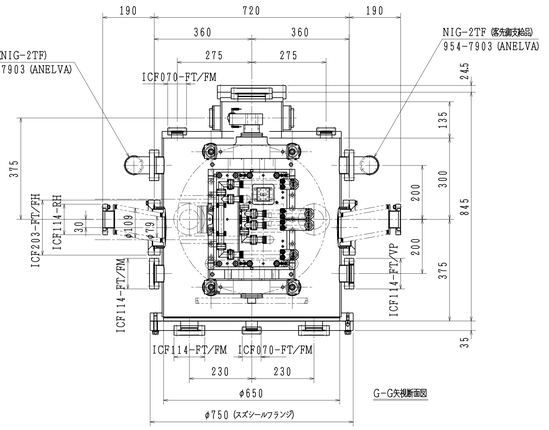


A－A矢視断面図

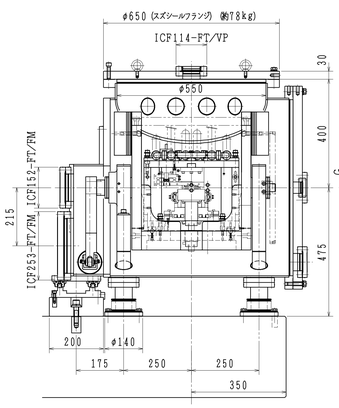




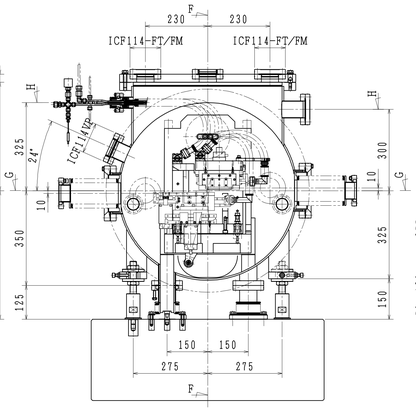
H－H矢視断面図



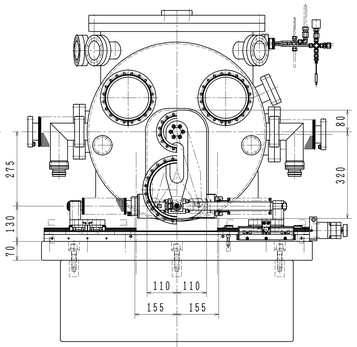
G－G矢視断面図



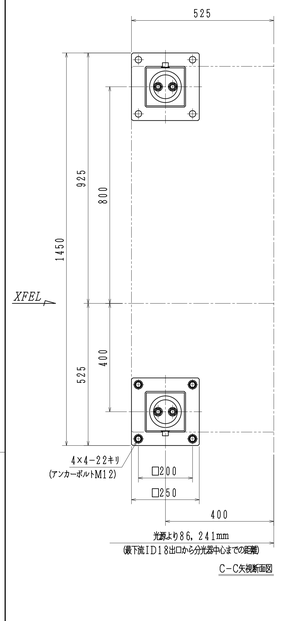
F－F矢視断面図



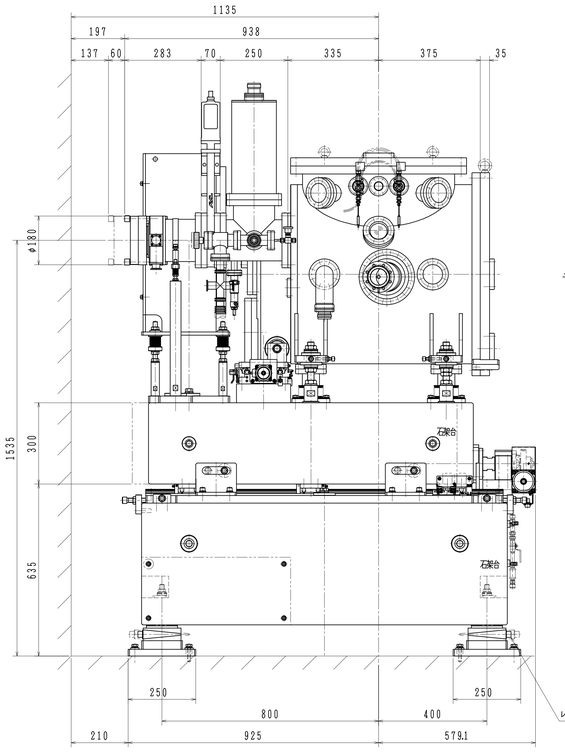
E－E矢視断面図



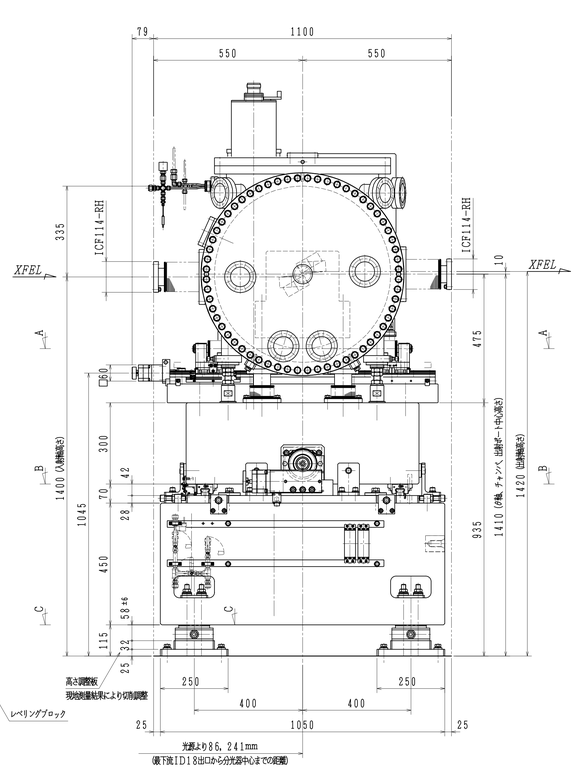
I－I矢視断面図



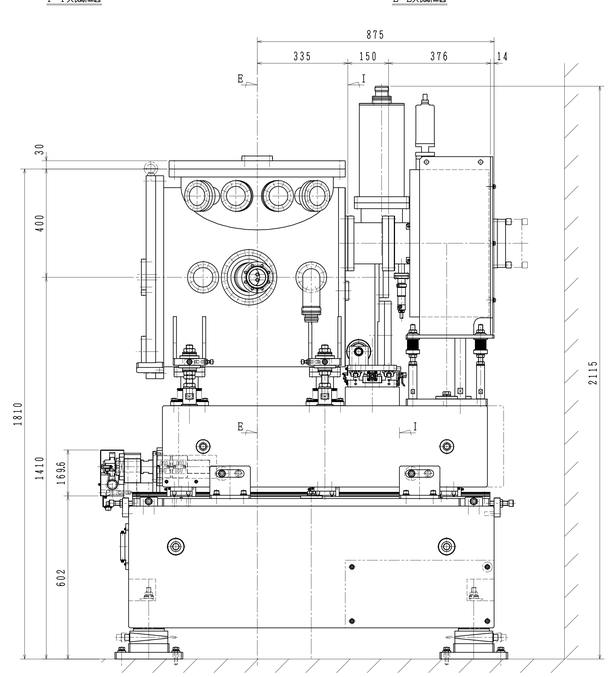
C－C矢視断面図

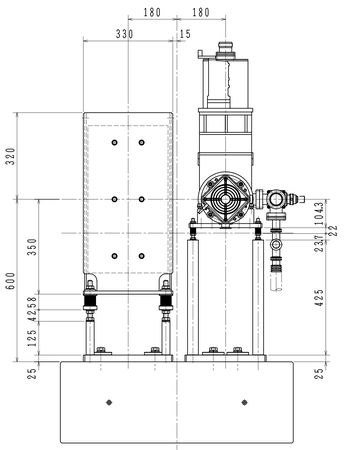


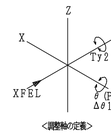
結晶退避
(CCW) −60mm 0mm (CW)
X軸
分解能 0.2μm/pulse



結晶回転
(CCW) −1° 30° (CW)
θ軸
分解能 0.03arcsec/pulse (分解能)
0.145μrad/pulse)







<調整軸の定義>

<架台調整仕様>

軸	調整範囲	調整法	送り量
水平方向	±15mm	M16押しネジ	2mm/rev
鉛直方向	±6mm	レベリングブロック	0.3mm/rev
	±30mm	高さ調整板の切削による	

<御支給品アクチュエータ基本性能>

N216	axis-1
Total range	20mm
Max velocity closed-loop	>626μm/s
Slipping force	>700N
Resolution closed-loop	5nm

<駆動軸仕様>

軸	駆動範囲	駆動分解能	アクチュエータ
ΔZ1	±1mm	アクチュエーター性能による。	ピエゾ駆動 (御支給品)
Δθ1	±0.5deg	0.1μrad/アクチュエーター駆動1nm	ピエゾ駆動 (御支給品)
Ty2	±0.5deg	0.1μrad/アクチュエーター駆動8nm	ピエゾ駆動 (御支給品)
θ	−1～30deg	0.145μrad/pulse (分解能)	ステッピングモータ
		サインバー長：275mm	
		出進ステージ：0.04μm/pulse	
X	−60～0mm	0.2μm/pulse	ステッピングモータ

注記
1). θ軸リニアスケール視点位置は、θ角15deg位置とします。
2). θ軸ロータリーエンコーダ原点位置は、θ角0deg位置とします。
3). θ軸リミットスイッチは、−2～31degで設定のこと。
4). X軸リミットスイッチは、−61～1mmで設定のこと。

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	品番	図番	品名	材質	素材寸法	処理	備考

一般公差			製図	設計	製図	品名	XFEL二結晶分光器 (DCM) 総組立
基準寸法	普通公差	記号	畑 中	Shimizu	Shimizu		
6以上 30以下	±0.2	A	10-04-16	10-04-14	10-04-14		
30以上 120以下	±0.3	B				尺度	1:8
120以上 315以下	±0.5	C				図番	0AB-00787A
315以上1000	±0.8	D	変更記事	年月日	氏名		

TOYAMA co.,ltd